

Ⅲ 超精密加工・成膜システムの開発

Ⅲ.1 プラズマCVM (Chemical Vaporization Machining)

Ⅲ.2 EEM (Elastic Emission Machining) による超精密加工法の開発

Ⅲ.3 大気圧プラズマCVD (Chemical Vapor Deposition) による高速成膜